

ひとわざ(一技)名: $\phi 500$ 大口径セラミックスの凹面研削 公差 $3\mu\text{m}$

1. 概要

当社は、半導体製造装置の大口径化($\phi 450$ クラス)を見据え、ロータリ研削加工の技術と、最大 $\phi 500\text{mm}$ のワークを測定できる平面度・平行度測定装置を開発・導入しました。

初期の試作開発に向けに形状の作り込みが容易で、多品種少量に幅広く対応したシステムです。

◆ $\phi 500$ 大口径セラミックス研削技術

- ・ 大口径セラミックス(最大 $\phi 500\text{mm}$)を、寸法公差 $\pm 3\mu\text{m}$ で研削します。
- ・ 凹面研削、平面研削が可能です。
- ・ 当社が所有するロータリ研削盤の加工技術を、最大 $\phi 500\text{mm}$ の測定ができる平面度・平行度測定装置で検証済みです。凹面形状をトライ&エラーで作り込むことができます。

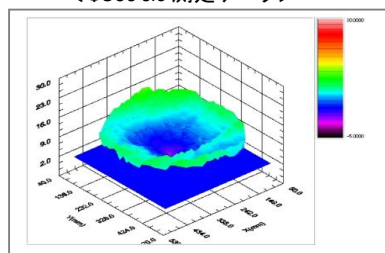
写真・図(要点説明)

凹面形状の作り込みが可能なロータリー研削盤

最大 $\phi 500\text{mm}$ が測定可能な平面度・平行度測定装置測定物: $\phi 500\text{SiC}$ 平面研削加工 $12\mu\text{m}$ 凹面仕上げ

< 研削仕上げによる表面状態(実績値) >

- ・ SiC : $Ra \leq 0.03$
- ・ SiO_2 : $Ra \leq 0.05$
- ・ Si : $Ra \leq 0.05$
- ・ LTCC : $Ra \leq 0.08$

< $\phi 500\text{SiC}$ 測定データ >

2. 企業概況

フリガナ

サンリツテクノ カブシキカイシャ

フリガナ

イシイ マサノリ

会社名

サンリツテクノ株式会社

代表者名

石井 昌典

フリガナ

イシイ マサノリ

窓口担当

石井 昌典

事業内容

受託加工

URL

http://www.@sanritsutechuno.co.jp

主要製品

セラミックス・ガラス・結晶材料の精密微細加工

フリガナ

ヤマナシケン フェフキシ イサワチョウ イド

住所

〒406-0045 山梨県笛吹市石和町井戸211-4

電話/FAX

055-263-7632 / 055-263-7527

E-mail

info@sanritsutechuno.co.jp

資本金(百万円)

15

設立年月

1970年7月

売上(百万円)

200

従業員数

27

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③SDGsへの取り組み 他

切断・研削・研磨・穴あけ等の精密機械加工を得意とし、チャレンジ的な加工にも積極的に取り組んでいます。
チャンピオン1個の製作から、製品の作り込み、開発から量産化までをサポートします。